S ドープ InP バルクのスピン緩和 Spin relaxation in S doped InP bulk 早大先進理工 ^o滝沢 将也、田中 大介、飯田 真之、谷川 詩馬、竹内 淳 Waseda Univ.

 M. Takizawa, D. Tanaka, M. Iida, S. Tanigawa, and A. Tackeuchi E-mail address: m-tkzw.phys@akane.waseda.jp

InPは、小さな有効質量と高い電子移動度を持っため、高電子移動度トランジスタ(HEMT)等の 高速デバイスへの応用において重要である¹。本 研究では、時間分解ポンププローブ反射計測によ り、SドープInPバルクのキャリア緩和及びスピン 緩和を観測し、以前報告したノンドープInPバル クの結果²と比較した。

本研究で用いたサンプルは、n型特性を有する 厚さ350±25µmのSドープInPバルクである。以前 測定したサンプルは、リン空孔によるn型特性を 有する厚さ1100µmノンドープInPバルクである。 キャリア濃度はそれぞれ2.55 - 2.70 × 10¹⁸ cm⁻³ と7.8 - 7.9 × 10¹⁵ cm⁻³である。両サンプル共に、 英国Wafer Technology 社製であり、成長方法は液 体封止チョクラルスキー(LEC)法である。

電子のスピン緩和の観測には、円偏光時間分解 ポンププローブ反射計測を用いた³。励起光源に はフェムト秒超短パルスチタンサファイアレー ザーを使用した。本実験系の時間分解能はパルス の時間幅に依存しサブピコ秒である。

Fig. 1、 Fig. 2 に S ドープ InP バルク及びノン ドープ InP バルクの温度 10 K、励起光強度 60 mW におけるポンププローブ反射計測の結果を 示す。I⁺はポンプ光とプローブ光が同一円偏光の 場合、「は逆円偏光の場合の反射光強度の時間変 化である。スピン偏極率(I⁺ - I)/(I⁺ + I)の緩和に 単一指数関数近似を用いて得られたスピン緩和 時間はSドープ InP バルクが 18.7 ps、ノンドープ InP バルクが 705 ps であった。また室温における スピン緩和時間はSドープ InP バルクが 25.3 ps、 ノンドープ InP バルクが 46.9 ps であった。Fig. 1 のI+とIの和の緩和から二重指数関数近似で求め た S ドープ InP のキャリア緩和時間は、7.10 ps と137 ps であった。Fig. 2 においても同様の方法 で求めると、ノンドープ InP のキャリア緩和時間 は、260 psと840 psであった。キャリア緩和時間、 スピン緩和時間共に、S ドープ InP の方が短いこ とから、不純物が関与するスピン緩和機構である Elliot-Yafet(EY)効果が働いていると考えられる⁴。



Fig. 1 Time evolutions of spin-dependent reflection intensity and spin polarization in S doped InP at 10 K for the excitation power of 60 mW. Black line shows single exponential fitting.



Fig. 2 Time evolutions of spin-dependent reflection intensity and spin polarization in Undoped InP at 10 K for the excitation power of 60 mW. Black line shows single exponential fitting.

¹Y. Yamashita et al., IEEE Electron Device Lett. **23**, No. 10, 573-575, (2002).

² M. Iida et al., The 77th JSAP Autumn meeting, 14p-C41-10 (2016).

³ A. Tackeuchi et al., Appl. Phys. Lett. 56, 2213 (1990),

⁴ R. J. Elliot, Phys. Rev. 96, 266 (1954).